

SEF800-G

- 二次元表面粗さと輪郭形状の測定が、検出器を交換するだけで可能
- より高度な解析機能、プラトー表面解析ソフトと接触点フィルタを標準装備
- 移動速度の向上 上下左右の移動速度を大幅に UP
- 検出器過負荷停止機能標準装備
- Measurement of “Two-dimensional surface roughness” and “contour (form)” is possible only by exchanging Pick-up
- With Plateau surface analyzing software and Morphological contact-point filter
- Improved the positioning speed
- Equipped with pick-up overload halt function as standard

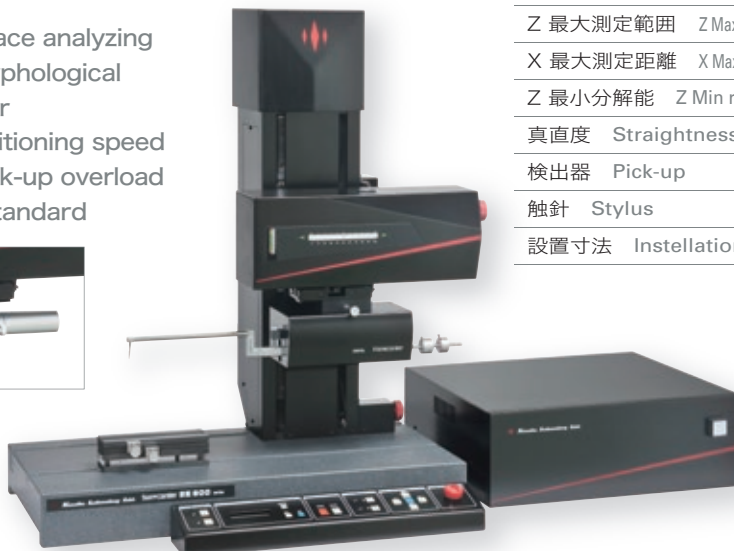


仕様 | SPECIFICATION |

表面粗さ Surface roughness		
Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	600 μm
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	0.04 nm
真直度	Straightness	0.2 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-DJ2S-60
触針	Stylus	R2 μm 60°
輪郭形状 Contour (form)		
Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	50 mm
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	0.1 μm
真直度	Straightness	1.0 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-FG25
触針	Stylus	SB-609 片刃形 Chisel type R25μm 8°
設置寸法	Installation size	W1500 mm×D800 mm

SEF800-N

- 輪郭形状検出器にデジタルスケールを採用、高分解能、高精度測定が可能
- より高度な解析機能、プラトー表面解析ソフトと接触点フィルタを標準装備
- 移動速度の向上 上下左右の移動速度を大幅に UP
- 検出器過負荷停止機能標準装備
- A digital scale is installed as a contour Pick-up element, and a high resolution and high accuracy measurement are possible
- With Plateau surface analyzing software and Morphological contact-point filter
- Improved the positioning speed
- Equipped with pick-up overload halt function as standard



仕様 | SPECIFICATION |

表面粗さ Surface roughness		
Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	600 μm
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	0.04 nm
真直度	Straightness	0.2 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-DJ2S-60
触針	Stylus	R2 μm 60°
輪郭形状 Contour (form)		
Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	60 mm
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	0.025 μm
真直度	Straightness	1.0 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-FN30
触針	Stylus	SB-610 片刃形 Chisel type R25μm 8°
設置寸法	Installation size	W1500 mm×D800 mm